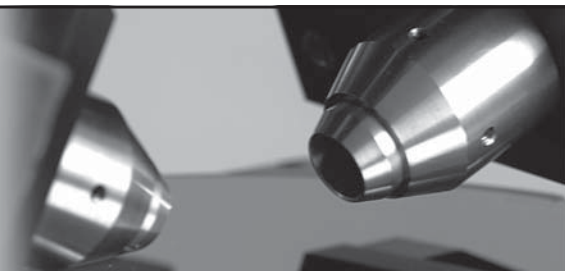


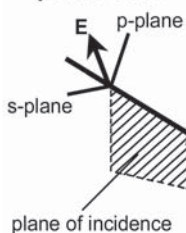
J.A. Woollam Japan

Ellipsometry Solutions



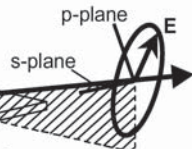
# 分光エリプソメーター

1. Known input polarization



2. Reflect off sample ...

3. Measure output polarization



薄膜の膜厚

異方性

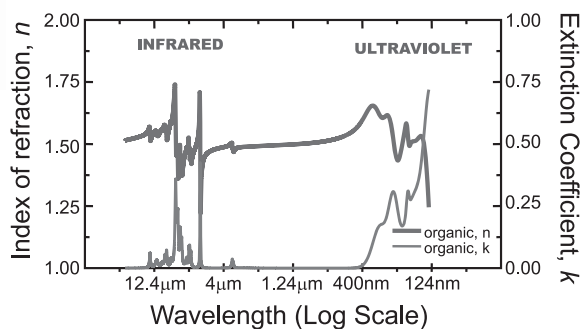
表面層・界面層

光学定数

(屈折率n, 消衰係数k)

化学結合情報

膜構成物質の  
混合比



146 400

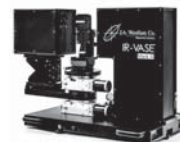
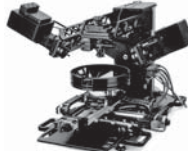
1000

1700

2500

4000

30,000



What is エリプソメーター?

分光エリプソメーターは、薄膜の厚み、光学定数(屈折率n、消衰係数k)および、表面や物質の微細構造を任意の波長範囲の偏光した光を利用して測定する、非破壊・非接触の大変感度の良い測定装置です。ある偏光状態の光を斜めから膜に当てると、反射した光は膜の作用により偏光の変化が起きます。光の強度に依存しない偏光の変化を測定するため、再現性がよく高感度な測定ができます。

ジェー・イー・ウーラム・ジャパン株式会社

〒167-0051 東京都杉並区荻窪 5-22-9 藤ビル2F  
TEL. 03-3220-5871 FAX. 03-3220-5876

info@jawjapan.com  
www.jawjapan.com